PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10~018093

(43)Date of publication of application: 20,01,1998

(51)Int.Cl.

C25D 13/08 C25D 13/20

(21)Application number: 08-168011

(71)Applicant: NIPPON PAINT CO LTD

(22)Date of filing:

27.06.1996

(72)Inventor: SASAKI MOTOHIRO

YOSHIOKA KATSUAKI NAGAI KATSUTOSHI

(54) FILM FORMING METHOD AND FILM FORMING METAL MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a coating film having excellent adhesion property with a metal and corrosion resistance by dipping a metal material in a soln, containing a specified material.

SOLUTION: After a iron-based metal material or the like is degreased, the metal is subjected to pretreatment with an amino-based coupling agent. Then the metal is dipped in a soln, containing at least one kind of the following compans. A, B and C, The compan. A is a monomer having active ester groups are sulfonium groups in one molecule, the compan. B is an emulsion having active ester groups which can be obtd, by copolymn, of the compan. A and radical polymerizable unsatd, monomers, and the compan. C is a composite emulsion which has active ester groups and consists of inorg, particles as cores each coated with a coating layer of a copolymer of the compan. A and radical polymerizing unsatd, monomers. The active ester groups included in the compan. A, B and C fast react with the amino groups in the coupling agent used in the pretreatment process at normal temp, to form bonds such as "CO-NH". Thereby, a coating film having excellent adhesion property and corrosion resistance is formed on the metal surface.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-18093

(43)公開日 平成10年(1998) 1月20日

| (51) Int.CL ⁸ | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI | | | 技術表示箇所 |
|--------------------------|-------|------|--------|------|-------|---|--------|
| C 2 5 D | 13/08 | | | C25D | 13/08 | | |
| | 13/20 | | | | 13/20 | C | |

審査請求 未請求 請求項の数4 〇L (全 20 頁)

| (21)出願番号 | 特臘平8-168011 | (71)出版人 000230054 | | | | |
|----------|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | 日本ペイント株式会社 | | | | |
| (22)出職日 | 平成8年(1996)6月27日 | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目1番2号 | | | | |
| | | (72)発明者 佐々木 蒸篦 | | | | |
| | | 東京都品川区南品川4丁目1番15号 日本 | | | | |
| | | ペイント株式会社東京事業所内 | | | | |
| | | (72)発明者 吉岡 克昭 | | | | |
| | | 東京都品川区南品川4丁目1番15号 日本 | | | | |
| | | ペイント株式会社東京事業所内 | | | | |
| | | (72)発明者 長井 勝利 | | | | |
| | | 山形県米沢市下花沢2丁目6番61号 | | | | |
| | | (74)代理人 弁理士 吉田 研二 (外2名) | | | | |

(54) 【発明の名称】 皮膜形成方法及び皮膜形成金属素材

(57) 【要約】

【課題】 リンやクロム化合物を使用せず、スラッジを 発生させない耐食性に優れた金属表面の皮膜形成方法を 提供する。

【解決手段】 金属素材に対して、(a) 脱脂処理工程、(b) アミノ系カップリング剤及び/又はメルカプト系カップリング剤による前処理工程、(c) 下記(c-1)の皮膜形成工程、を順次経て、(c-1)の皮膜形成工程は、(A)、(B) 又は(C)の少なくとも1種の組成を含む水溶液に浸漬することにより皮膜を形成する工程であり、(A) 活性エステル基及びスルホニウム基を同一分子内に含有するモノマー、(B) 上記(A) のモノマーとラジカル重合性不飽和モノマーとの共重合により得られる活性エステル基を有するエマルション、(C) 無機粒子を核として、上記(A) のモノマーとラジカル重合性不飽和モノマーとの共重合してなる被覆層で上記無機粒子が被覆された活性エステル基を有する複合エマルションである。

[特許請求の範囲]

【請求項1】 金属素材に対して、下記(a)~(c)の工程を順次経る皮膜形成方法であって、

- (a) 脫脂処理工程、
- (b) アミノ系カップリング剤及び/又はメルカプト系 カップリング剤による前処理工程。
- (c)下記(c-1)又は(c-2)の皮膜形成工程、前記(c-1)の皮膜形成工程は、下記(A),(B)又は(C)の少なくとも1種の組成を含む水溶液に浸漬することにより皮膜を形成する工程、
- (A) 活性エステル基及びスルホニウム基を同一分子内 に含有するモノマー、
- (B)上記(A)のモノマーとラジカル重合性不飽和モノマーとの共重合により得られる活性エステル基を有するエマルション、

(C)無機粒子を核として、上記(A)のモノマーとラジカル重合性不飽和モノマーとの共重合してなる被覆層で上記無機粒子が被覆された活性エステル基を有する複合エマルション、

前記(c-2)の皮膜形成工程は、上記(A)、(B) 又は(C)の少なくとも1種の組成を含む水溶液に前記 金属素材を浸漬し、この金属素材を陰極として、前記陰 極と陽極との間に通電し、前記組成を電解重合させるこ とにより皮膜を形成する工程、

であることを特徴とする皮膜形成方法。

【請求項2】 請求項1に記載の(A)活性エステル基 及びスルホニウム基を同一分子内に含有するモノマー が、下記化1に示す一般式(I)を有することを特徴と する皮膜形成方法。

(化1)

(式中、重合性基とスペーサーの組み合わせは下記化2 の通り、またW及びXは化3の通りである。) [化2]

[化3]

X=対アニオン

X:
$$HSO_4^-$$
. $CH_3SO_4^-$, $H_2PO_4^-$, HCO_3^- . CH_3COO^- . $HCIO_4^-$, CH_3-COO^- . Br^- . CI^-

【請求項3】 請求項1に記載の(A)活性エステル基 も1種であることを特徴とする皮膜形成方法、 及びスルホニウム基を同一分子内に含有するモノマー 【化4】 が、下記化4に示す構造式を有するモノマーの少なくと

エー対アニオン

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれかの皮膜形成方法によって皮膜形成することを特徴とする皮膜形成金属素材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は皮膜形成方法、特に 金属素材の下地処理(表面処理)において金属表面との 密着性及び耐食性に優れた有機皮膜あるいは有機皮膜及 び無機皮膜を形成する皮膜形成方法及び皮膜形成された金属素材に関する。

[0002]

【従来の技術】通常、金屬表面に塗装する場合には、まず金属表面の脱脂を行った後、下地処理(表面処理)を行い、その後塗装を行う。従来、金属表面処理としては、金属表面に耐食性を付与したり、金属表面上に塗装される塗料と金属表面との密着性を向上させるために、

例えばリン酸亜鉛処理あるいはクロメート処理が行われている。

【0003】しかしながら、リン酸亜鉛処理の場合には、廃水中に含まれるリンが水質の富栄養化をもたらし、水質汚染の原因となるおそれがあり、また表面処理中にスラッジも発生する。一方、クロメート処理の場合には、処理液中のクロムが有害物質であり、環境や人体に悪影響を及ぼすおそれがある。このため、通常、高価な廃水処理設備が必要となり、経済性にやや劣るという問題があった。

$$(R)_{a}(R^{1})_{b}(R^{2})_{c}\overset{\bigoplus}{s}A^{\Theta} (H)$$

(式中、Rは、場合により置換された、一価の芳香族有 機基を意味し、R¹ は、場合により置換された、一価の 有機脂肪族基で。アルキルー、シクロアルキルー及び置 換アルキル基の群からの1つの基を意味する。

【0007】R² は、場合により置換された、二個又は 三個の脂肪族又は芳香族有機基を意味し、そして複繁環 式又は締合環構造を形成する。

【0008】aは、0より3まで(3を含む)の整数で

物質を金属表面処理液に含まず、更にスラッジを発生しない、耐食性に優れた皮膜形成方法が望まれている。 【0005】なお、特開平2-264756号公報の 「感放射線性のあるエチレン系不飽和の共重合可能なスルホニウム塩及びその製造方法」には、下記化5に示す 一般式(11)の構造を有する光硬化性組成物が開示され

【0004】そこで、近年では、リンやクロム等の有害

[0006] [化5]

ている。

あり、bは、0より2まで(2を含む)の整数であり、cは、0又は1に等しい整数であり、その際、和a+b+c=3である。

【0009】A二は、酸の陰イオンを表す。

【0010】そして基R~R² の少なくとも1つは下記 化6に示す基の1つを結合して含み。

[126]

上記化6の式中のWは、単結合又は下記化7に示す基の 【化7】 1つを表し、

上記化6の式中のXは、二種の、場合により置換された (化8) 下記化8に示すアルキレン基で、

$$-(CH_{2})_{n} - \begin{bmatrix} R' \\ -C - \\ R' \end{bmatrix}_{n} = 1 - 10$$

そのR とR は互いに同一又は異なりかつアリール、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、H、COOH、 $COOCH_0$ 、COOCH0 、COOCH0 、COOCH0 、COOCH0 と表すもの、パーフルオロアルキレン基、オキサアルキレン基 $-(CH_2)_n -O-(CH_2)_n -O-(CH_2)_n -O-(CH_2)_n +O-(CH_2)_n +O-($

た、ポリオキサアルキレン基で $2\sim20$ の酸素原子を含み、それらの酸素原子の少なくとも1つの-CH $_2$ - - CF $_2$ - 又は-CH $_2$ -CH (CH $_3$) - 基を介して互いに結合されれいるもの、- (CH $_2$) $_a$ -O-CO-N H-(CH $_3$) $_a$ - - (CH $_3$) $_a$ - NH-CO-O

-(CH₂)_n -

 $-(CH_2)_* -O-CO-(CH_2)_n -Xは-(CH_2)_* -CO-O-(CH_2)_n -、[m=1~1 O, n=1~10] の基の1つ、場合により1~4 炭素原子を含むアルキル、OH、OCH₈、OC₂H₅、SH、SCH₈、SC₂H₆等により<math>\sigma$ 、m-及 σ /又は σ -位置に置換されたフェニレン基等を表す。

【0011】Yは、H. 1~6炭素原子を含むアルキル

又はフェニルを、Zは、O又はNYを表す。) また、特開平5-32618号公報の「新規アクリレー ト化合物」には、臨床診断用薬の担体等に利用される機 能性高分子の原料として、下記化9に示す構造を有する 新規アクリル誘導体が開示されている。

[0012] UE91

(玄中、Rは水素、C, $\sim C$, Oアルキル基、フェニル素、

 R_1 は水業、 $C_1 \sim C_4$ のアルキル基、

 R_q 、 R_q お独立して水準、ハロゲン、 $C_1 \sim C_4$ のアルキル基、

 R_{\star} , R_{s} は独立して C_{1} $\sim C_{s}$ のアルギル基を示す。

Xはアルキル磁酸イオン、ハロゲンイオン、過塩蒸酸イオン、磁酸水業 イオン、p…トルエンスルホン酸イオンのいずれかである。)

また、米国特許4,528,384号には、カチオン性 の新規ポリマーの原料として、例えば下記化10に示す 構造を育するエチレン性不飽和芳香族スルホニウム塩等 が開示されている。 【0013】 【化10】

$$CH_{2} = CH \qquad \bigcirc -CH_{2}O - \bigcirc S \stackrel{\bigoplus}{\bigoplus} X \stackrel{\bigoplus}{\longrightarrow} X \stackrel{\bigoplus}{\longrightarrow} CH_{2} = CH - C - O - \bigcirc S \stackrel{\bigoplus}{\bigoplus} X \stackrel{\bigoplus}{\longrightarrow} X$$

(式中、X^台はC1~、CH3 COO~等のアニオンである。)

[0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記特開平2-264756号公報、特開平5-32618号公報、米国特許4,528,384号のそれぞれに開示されたエチレン性不飽和芳香族スルホニウム塩は、いずれも光硬化性組成物や、臨床診断用薬の担体や、カチオン界面活性剤に用いられるものであり、金属素材の塗装前の下地処理に用いた残はない。

【0015】すなわち、現在、金属材料表面の下地処理において、金属表面に有機皮膜又は有機/無機皮膜からなる皮膜を形成する方法は見当たらず、依然として環境対策やスラッジ防止方法を講じながら、金属表面の下地処理を行わなければならなかった。このため、高価な廃水処理設備や金属表面処理設備が必要となり、経済性に劣る。

【0016】本発明は上記従来の課題に鑑みたものであ

り、その目的は、金属素材の下地処理(表面処理)において金属表面との密着性及び耐食性に優れた有機皮膜あるいは有機皮膜及び無機皮膜を形成する皮膜形成方法を 提供することである。

[0017]

【課題を解決するための手段】前述した目的を達成するために、本発明に係る皮膜形成方法は、金属素材に対して、下記(a)~(c)の工程を順次経る皮膜形成方法であって、(a)脱脂処理工程、(b)アミノ系カップリング剤及び/又はメルカブト系カップリング剤による前処理工程、(c)下記(c-1)又は(c-2)の皮膜形成工程、前記(c-1)の皮膜形成工程は、下記(A)、(B)又は(C)の少なくとも1種の組成を含む水溶液に浸漬することにより皮膜を形成する工程、(A)活性エステル基及びスルホニウム基を同一分子内に含有するモノマー、(B)上記(A)のモノマーとラ

ジカル重合性不飽和モノマーとの共重合により得られる活性エステル基を有するエマルション、(C)無機粒子を核として、上記(A)のモノマーとラジカル重合性不飽和モノマーとの共重合してなる被覆層で上記無機粒子が被覆された活性エステル基を有する複合エマルション、前記(c-2)の皮膜形成工程は、上記(A)、(B)又は(C)の少なくとも1種の組成を含む水溶液に前記金属素材を浸漬し、この金属素材を陰極として、前記降極と陽極との間に通電し、前記組成を電解重合させることにより皮膜を形成する工程、である皮膜形成方法である。

【0018】(c)皮膜形成工程における上記(A),(B)又は(C)の組成に含まれる(A)モノマーの活性エステル基は、(b)前処理工程で用いられるカップリング剤中のアミノ基やチオール基と常温で素早く反応する反応性が高い官能基である。従って、(b)前処理工程において、金屬表面に予めアミノ基やチオール基のような官能基を固定化しておけば、アミノ基やチオール基のような官能基と活性エステル基が反応して、一COーNH一やCOーSー結合が形成され、上記(A),(B)又は(C)の組成からなる密着性及び耐食性に優れた有機皮膜あるいは有機皮膜/無機皮膜を金属表面に形成することができる。

[0019]

【発明の実施の形態】上述したように、本発明に係る皮 膜形成方法は、金屬素材に対して、下記(a)~(c) の工程を順次経る皮膜形成方法であって、(a) 脱脂処 理工程、(b) アミノ系カップリング剤及び/又はメル カプト系カップリング剤による前処理工程、(c)下記 (c-1) Xは(c-2) の皮膜形成工程、前記(c-1 〉の皮膜形成工程は、下記(A),(B)又は(C) の少なくとも1種の組成を含む水溶液に浸渍することに より皮膜を形成する工程、(A)活性エステル基及びス ルホニウム基を同一分子内に含有するモノマー、(B) 上記(A)のモノマーとラジカル重合性不飽和モノマー との共
重合により得られる活性エステル基を有するエマ ルション、(C)無機粒子を核として、上記(A)のモ ノマーとラジカル量合性不飽和モノマーとの共量合して なる被覆層で上記無機粒子が被覆された活性エステル基 を有する複合エマルション、前記 (c-2)の皮膜形成 工程は、上記(A). (B) Xは(C)の少なくとも1 種の組成を含む水溶液に前記金属素材を浸渍し、この金 **屬素材を陰極として、前記陰極と陽極との間に通電し、** 前記組成を電解重合させることにより皮膜を形成する工 程。である皮膜形成方法である。

【0020】さらに、本発明に係る皮膜形成金属素材としては、例えば鉄、アルミニウム、亜鉛、溶融亜鉛めっき鋼板等の合金化めっき鋼板、各種めっき鋼板、ステンレス等に、上記皮膜形成方法により皮膜を形成したものである。

【0021】(a) 脱脂処理工程

アルカリまたは酸を用いて、金属表面に付属している油 脂等を除去する工程をいう。

【0022】(b)前処理工程

アミノ系カップリング利及び/又はメルカプト系カップ リング剤を用いて、金属素材表面に、アミノ基及び/又 はメルカプト基(一SH基、又はチオール基ともいう) を固定する工程である。上記カップリング剤を金属表面 に固定化する方法として、浸漬処理方法と電解重合処理 方法の2通りの方法を用いることができる。

【0023】<浸漬処理方法>浸漬処理方法は、下記カ ップリング剤を以下に示す溶媒に所定認度溶解させ、こ の浸漬液中に金属素材を所定時間浸漬する方法である。 【0024】上記カップリング剤としては、例えば3~ アミノプロピルトリメトキシシラン (チッソ (株) 製。 「S360」), 3ーアミノプロビルトリエトキシシラ ン (チッソ (株) 製、「S330」), Nー(2-アミ フエチル) ー3ーアミノプロピルトリメトキシシラン (チッソ(株)製、「SS20」)、N-(2-アミノ エチル) -3-アミノプロビルメチルジメトキシシラン (チッソ(株)製、「S310」),N…(トリメトキ シシリルプロピル) エチレンジアミン (東レダウ(株) 製、「SH6020」)、3ーウレイドプロビルトリエ トキシシラン (チッソ (株) 製、「UPS-E」)。 イ ソプロピルトリ(N-アミドエチル・アミノエチル)チ タネート(味の素(株)製、「プレンアクトKR4 4」)等のアミノ基を有するアミノ系カップリング網 や。3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン(東レ ダウ (株) 製、「SH6062」), 3ーメルカブトブ ロピルメチルジメトキシシラン(東レグウ(株)製、 「SH6062」)等のメルカプト基を有するメルカプ ト系カップリング剤が好ましい。

【0025】上記溶媒としては、例えば水、エタノール、メタノール、イソプロビルアルコール(IPA)、アセトン、メチルエチルケトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、クロロホルム、塩化メチレン等が挙げられ、好ましくは水、エタノール、メタノール、イソプロビルアルコール(IPA)である。

【0026】また、浸漬液中の上記カップリング剤の濃度は、好ましくは0.1~10wt%であり、より好ましくは0.5~3wt%である。上記カップリング剤の濃度が0.1wt%未満の場合には、金属表面に対する上記カップリング剤の固定化が不十分なため、金属表面へ上記(A),(B)又は(C)の組成物が折出しにくくなる。このため、耐食性が低下する。一方、上記カップリング剤の濃度が10wt%を超える場合には、浸漬液の糖合反応が起こりやすくなり保存安定性が劣化する。

【0027】また、金属素材の浸漬液中への浸渍時間

は、0.1秒~10分が好ましく、より好ましくは1秒~5分である。浸漬時間が0.1秒未満の場合には、金屬表面へ上記(A),(B)又は(C)の組成物が折出しにくくなる。このため、皮膜が薄くなり耐食性が低下する。一方、浸漬時間が10分を超えても、所望の皮膜以上の効果は得られず、処理時間が長くなるのみである。

【0028】〈電解重合処理方法〉電解重合処理方法 は、下記カップリング剤と下記の支持電解質とを溶媒に 溶かして、金属素材を陰極にして、陰極と陽極との間に 通電し、下記カップリング剤を電解重合させ、金属表面 に重合させて固定化する方法である。

【0029】上記カップリング剤としては、2,4,6 ートリメルカプトーSートリアジンチオールモノナトリウム塩(三協化成(株)製、「サンチオールNー 1」),2,4,6ートリメルカプトーSートリアジンチオールトリナトリウム塩(三協化成(株)製、「サンチオールNーW」)等のトリアジンチオールが好ましい。

【0030】上記溶媒は、水が好ましい。また、支持電解質としては、炭酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム等が好ましい。

【0031】電解質溶液の上記カップリング剤の濃度は、好ましくは0.1 mM~100 mMであり、より好ましくは5 mM~50 mMである。上記カップリング剤の濃度が0.1 mM未満の場合には、金属表面へ上記(A)、(B)又は(C)の組成物が析出しにくくなる。このため、皮膜が薄くなり耐食性が低下する。一方、上記カップリング剤の濃度が100 mMを超える場合には、電解重合時に凝集物が析出して、後の(c)皮膜形成工程に支障が生じる。

【0032】また、電解重合時における電流密度は、 2.5~30mA/cm²が好ましく、より好ましくは 10~20mA/cm²である。電流密度が2.5mA/cm²未満の場合には、金属表面に対する上記カップ リング剤の固定化が不十分であるため、金属表面へ上記 (A), (B) 又は(C)の組成物が析出しにくくなる。従って、皮膜が薄くなり耐食性が低下する。一方、電流密度が30mA/cm²を超えた場合には、金属表面への上記(A), (B) 又は(C)の組成物の析出量は増えるものの、所望の耐食性を超える効果は得られず、経済性に劣る。

【0033】電解重合の通電時間は、10秒~5分が好ましく、より好ましくは30秒~60秒である。通電時間が10秒未満の場合には、金属表面に対する上記カップリング剤の固定化が不十分であるため、金属表面へ上記(A),(B)又は(C)の組成物が析出しにくくなる。従って、皮膜が薄くなり耐食性が低下する。一方、通電時間が5分を超える場合には、金属表面に対する上記カップリング剤の固定化量が増大し、その後の(c)皮膜形成工程において上記(A),(B)又は(C)の組成物からなる皮膜を形成しても、金属表面に対する皮膜の密着性が低下してしまう。

【0034】(c)皮膜形成工程

皮膜形成工程は、図1〜図3及び以下に述べる(cー1)皮膜形成工程又は(c-2)皮膜形成工程のいずれかを用いることができる。

【0035】(c-1)の皮膜形成工程

(c-1)の皮膜形成工程は、下記(A), (B)又は(C)の少なくとも1種の組成を含む水溶液に浸漬することにより皮膜を形成する工程である。

【0036】上記(A)活性エステル基及びスルホニウム基を同一分子内に含有するモノマー(以下、「AEM」という。なお、「AEM」はactive ester monomerの略である)の水溶液に浸漬して皮膜を形成する工程は、図1に示す通りである。

【0037】上記(A)活性エステル基及びスルホニウム基を同一分子内に含有するモノマー(AEM)は、下記化1に示す一般式(I)を有することが好ましい。

[8800]

[1611]

(式中、葉合性基とスペーサーの組み合わせは下記化1 2の通り、またW及びXは化13の通りである。)

【化12】

$$AA-\phi-: -(CH_2)_{\overline{n}} \cdot -(CH_2)_{\overline{n}} \cdot -(CH_2CH_2O)_{\overline{n}} -(CH_2CH_2NH)_{\overline{n}} -(CH_2CH_$$

【化13】

X=対アニオン

本実施形態において、活性エステル基は、上記構造式中 のベンセンに隣接するエステル基をいう。

【0039】更に好ましい(A)活性エステル基及びスルホニウム基を同一分子内に含有するモノマー(AE

M)は、下記化14に示す構造式を有するモノマーである。

[0040]

※=対アニオン

また、スルホニウム基Wは、上述のスルホニウム基の中で $-S-(CH_8)_2$ がより好ましい。また、対アニオンXは、 HSO_4 , CH_8 SO_4 , H_2 PO_4 が最も好ましく。より好ましくは Br^- , $C1^-$ であり、 HCO_8 , CH_8 COO^- , $HC1O_4$, P-トルエンスルホン酸イオンが好ましい。

【0041】また上記AEMは、上述の1種又は2種以 上使用してもよい。また、上記ABMの水溶液に水溶性 のラジカル重合性不飽和結合を有するモノマーを混合させてもよい。水溶性のラジカル重合性不飽和結合を有するモノマーとしては、例えばアクリル酸(AA)、メタクリル酸、アクリルアミド、ヒドロキシエチルメタアクリレート、Nービニルピロリドン等が挙げられる。

【0042】AEM水溶液中のAEM濃度は、0、01 ~15wt%が好ましく、より好ましくは0、1~10 wt%である。AEM濃度が0、01wt%未満の場合 には、金属表面へ皮膜が析出しにくくなる。このため、耐食性が低下する。一方、AEM濃度が15wt%を超える場合には、皮膜がむらになりやすく好ましくない。【0043】金属素材浸漬時のAEM水溶液の処理pHは、2~9が好ましく、より好ましくは3~6である。処理pHが2未満の場合には、AEMが加水分解される。一方、処理pHが9を超えると、やはりAEMが加水分解される。

【0044】金属素材浸漬時のAEM水溶液の処理温度は、0~40℃であることが好ましく、より好ましくは10~20℃である。処理温度が0℃未満の場合には、AEM水溶液が凍る。一方、処理温度が40℃を超えると、AEMが加水分解される。 AEM水溶液に対する金属素材の浸漬時間は、0、1秒~60秒が好ましく、より好ましくは1秒~15秒である。浸漬時間が0、1秒未満の場合には、金属表面へAEMが析出しにくくなる。このため、耐食性が低下する。一方、浸渍時間が60秒を超えても、所望の皮膜以上の効果は得られず、処理時間が長くなるものみである。

【0045】上記(B)上記(A)のモノマー(すなわちAEM)とラジカル重合性不飽和モノマーとの共重合により得られる活性エステル基を有するエマルション(以下「AEP」という。なお、「AEP」はactive ester polymerの略である。)の水溶液に浸漬して皮膜を形成する工程は、図2に示す通りである。

【0046】AEPは、上述のAEMと特に水不溶性の ラジカル重合性不飽和モノマーとの共進合体であって、 AEP水溶液はエマルションの形態となる。

【0047】上記水不溶性のラジカル重合性不飽和モノマーとしては、スチレン、pーメチルスチレン、pークロルメチルスチレン、メタクリル酸エステル、アクリル酸エステル、酢酸ビニル、塩化ビニル等が挙げられる。上記水不溶性のラジカル重合性不飽和モノマーが2種以上、AEMに共重合されていてもよい。

【0048】AEPのガラス転移温度(Tg)は、一50~120℃であることが好まして、より好ましては一25~100℃である。Tgが120℃を超えると、次工程の加熱処理工程において、融着温度が高温となり作業性が悪くなる。

【0049】AEP水溶液中のAEP濃度は、1~50 wt%が好ましく、より好ましくは10~30wt%である。AEP濃度が1wt%未満の場合には、金属表面へAEPが析出しにくくなる。このため、耐食性が低下する。一方、AEP濃度が50wt%を超える場合には、皮膜にむらができやすく好ましくない。

【0050】なお、金属素材浸漬時のAEP水溶液の処理pH、処理温度、浸漬時間は、上記(A)のAEMの場合と同様である。

【0051】上記(C)の複合エマルションは、無機粒子を核として、上記(A)のモノマーとラジカル重合性

不飽和モノマーとの共重合してなる被覆層で上記無機粒子が被覆された活性エステル基を有する複合エマルション(以下「AEP複合エマルション」という。)であって、上記(C)による皮膜形成方法は、図3に示す通り、AEP複合エマルションの水溶液に浸漬して皮膜を形成するものである。なお、ラジカル重合性不飽和モノマーとしては、上述の(B)のAEPの場合と同様のものを用いる。

【0052】AEP複合エマルションの核となる無機粒子としては、例えばシリカ、アルミナ、チタニア、フェライト、リン酸チタン、さらに鉄、亜鉛等の金属粒子等が挙げられる。また、この無機粒子の粒子径は、0.01~1μmが好ましく、より好ましくは0.01~0.5μmである。粒子径が0.01μm未満の場合には、良好なAEP複合エマルションが得られない。一方、粒子径が1μmを超える場合には、皮膜がむらになりやすく好ましくない。

【0053】また、上記(C)による皮膜形成方法におけるAEP複合エマルション水溶液中のAEP複合エマルションの濃度は、1~50wも%が好ましく。より好ましくは10~30wも%である。AEP複合エマルション濃度が1wも%未満の場合には、金属表面へAEP複合エマルションが析出しにくくなる。このため、耐食性が低下する。一方、AEP複合エマルション濃度が50wも%を超える場合には、皮膜がむらになりやすく好ましくない。

【0054】なお、金属素材浸漬時のAEP複合エマルション水溶液の処理pH、処理温度、浸漬時間は、上記(A)のAEMの場合と同様であり、AEP複合エマルションのガラス転移温度(Tg)は、AEPのガラス転移温度(Tg)と同様であるため説明を省略する。

【0055】(c-2)皮膜形成工程

(c-2)の皮膜形成工程は、上記(A),(B) 又は(C)の少なくとも1種の組成を含む水溶液に前記金属素材を浸漬し、この金属素材を陰極として、前記陰極と陽極との間に通電し、前記組成を電解重合させることにより皮膜を形成する工程である。なお、上記(A),

(B) 又は(C) は上述のものと同様であるため、記載を省略する。

【0056】(A)の組成物の浸漬溶液濃度は、好ましくは0.01wt%~15wt%であり、より好ましくは0.1wt%~10wt%である。上記組成物の濃度が0.01wt%未満の場合には、金属表面へ上記

(A)の組成物が析出しにくくなる。このため、皮膜が薄くなり耐食性が低下する。一方、上記いずれかの組成物の濃度が15wt%を超える場合には、上記組成物が電解運合中に凝集物が析出して、良好な皮膜形成を行うことができない。(B)又は(C)組成物の浸漬溶液濃度は、好ましくは1wt%~50wt%であり、より好ましくは10wt%~30wt%である。上記いずれか

の組成物の濃度が1wt%未満の場合には、金属表面へ上記(B)又は(C)の組成物が析出しにくくなる。このため、皮膜が薄くなり耐食性が低下する。一方、上記いずれかの組成物の濃度が50wt%を超える場合には、上記組成物が電気泳動中に凝集物が析出して、良好な皮膜形成を行うことができない。

【0057】また、電解単合時における電圧は、0、1~300Vが好まして、より好ましくは5~50Vである。電圧が0.1V未満の場合には、金属表面に対する上記(A)、(B)又は(C)のいずれかの組成物の析出が不十分となり、皮膜が薄くなり耐食性が低下する。一方、電圧が300Vを超えた場合には、金属表面への上記(A)、(B)又は(C)の組成物の析出量は増えるものの、所望の耐食性を超える効果は得られず、経済性に劣る。

【0058】電解重合時の通電時間は、0.1秒~5分が好ましく、より好ましくは30秒~60秒である。通電時間が0.1秒未満の場合には、金属表面に対する上記(A)、(B)又は(C)の組成物の析出が不十分となり、皮膜が薄くなり耐食性が低下する。一方、通電時間が5分を超える場合には、金属表面に対する上記(A)、(B)又は(C)のいずれかの組成物の析出が増大するものの、所望の耐食性を超える効果は得られず、経済性に劣る。

【0059】なお、図1〜図3に示される副生物を回収 して、再度AEM、AEP又はAEPエマルションを製 造して使用してもよい。

【0060】本発明の皮膜形成方法は、必要に応じて、 上記(c)皮膜形成工程の後、水洗して、熱処理工程を 加えてもよい。この加熱処理工程により、短時間で金属 表面により強固な有機皮膜(すなわち。(A)及び

(B)の組成物からなる皮膜)又は有機/無機皮膜(すなわち、(C)の組成物からなる皮膜)を固定することができる。なお、皮膜の膜厚は、0.01~1ヵmであることが好ましい。

【0061】熱処理工程

(A)のAEMを用いて皮膜形成した場合には、熱によりAEM同士重合して金属表面に強固な有機皮膜を形成する。なお、熱の代わりに光(例えば紫外線)を用いてもよい。

【0062】熱処理温度は、好ましくは70~150℃であり、より好ましくは90~120℃である。熱処理温度が70℃未満の場合には、AEMが重合せず、耐食性が低下する。一方、熱処理温度が150℃を超えても、単合速度に相違はなく、経済性が低下する。

【0063】また、熱処理時間は、10秒~10分が好ましく、より好ましくは30秒~5分である、熱処理時間が10秒未満の場合には、AEMが重合せず、耐食性が低下する。一方、熱処理時間が10分を超えても、重合率に相違はなく、経済性が低下する。

【0064】また、皮膜の重合率を上げるために、水溶 性の重合開始剤を添加してもよい。重合開始剤の添加の 仕方としては、(i)(c)皮膜形成工程において金属 表面にAEMを固定した後、このAEMが表面に固定さ れた金属素材を以下に述べる重合開始剤の水溶液に更に 浸漬してから熱処理を行ってもよく。また (ii) (c) 皮膜形成工程中のAEM水溶液中に以下に添べる革合開 始剤を予め添加して、この重合開始剤入りAEM水溶液 に金属業材を浸漬し、その後AEM水溶液から引上げた 後熱処理を行ってもよい。上記重合開始剤としては、例 えば2,2'-アゾビス(2-アミジノブロバン)二塩 酸塩(以下「AIBA」と略す)、4、4′-アゾビス (4-シアノ吉草酸)、2、2′-アゾビス[2-(5 ーメチルー2ーイミダゾリンー2ーイル) プロパントニ 塩酸塩、2,21ーアゾビスイソブチルアミド二水和 物、過硫酸塩、亜硫酸水素塩、亜硫酸塩が好ましい。上 記過硫酸塩等の無機重合開始剤の塩としては、アルカリ 金属塩又はアンモニウム塩が好ましい。

【0065】また、(B)のAEP及び(C)のAEP 複合エマルションを用いて皮膜形成した場合には、熱に よりAEP又はAEP複合エマルションを金属表面に融 着させ、金属表面に強固な有機皮膜((B)の場合)又 は有機/無機皮膜((C)の場合)を形成する。

【0066】熱処理温度は、使用する(B)のAEPXは(C)のAEP複合エマルションのガラス転移温度(Tg)以上の温度が好ましい。上記Tg未満の場合には、融着が不十分となり、耐食性がやや低下してしまう。

【0067】熱処理時間は、10秒~10分が好ましく、より好ましくは30秒~5分である。熱処理時間が10秒未満の場合には、AEMが重合せず、耐食性が低下する。一方、熱処理時間が10分を超えても、重合率に相違はなく、経済性が低下する。

【0068】また、皮膜の架橋度を上げるために、水溶性の架橋剤を添加してもよい。架橋剤の添加の仕方としては、(i)(c)皮膜形成工程において金属表面に

(B) AEP又は(C) AEP複合エマルションを固定した後、上記組成物が表面に固定された金属素材を以下に述べる架橋剤の水溶液に更に浸漬してから熱処理を行ってもよく、また(ii)(c)皮膜形成工程中の(B) AEP水溶液又は(C) AEP複合エマルション水溶液中に以下に述べる架橋剤を予め添加して、この架橋剤入り(B) AEP水溶液又は(C) AEP複合エマルション水溶液に金属素材を浸漬し、その後上記水溶液から引上げ、熱処理を行ってもよい。

【0069】上記架橋翔としては、水溶性アミンが好適であり、水溶性アミンとしては、例えばエチレンシアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、2ートリスアミノエチルアミン等が好ましい。

【0070】なお、上記熱処理工程を経なくとも、

(c)皮膜形成工程後、瞬時に、(A)のAEMはAE M同士架橋して強固な有機皮膜を形成する。また、

(B)のAEP及び(C)のAEPエマルションは粒子間架橋して強固な有機皮膜を形成する。

【0071】更に、本発明の好ましい他の実施態様を以下に示す。

【0072】1、本発明の皮膜形成方法における(b) 前処理工程は、アミノ系カップリング剤及び/又はメル カプト系カップリング剤を溶媒に所定濃度溶解させ、こ の浸漬液中に金属素材を所定時間浸漬する方法である。 【0073】2. (も)前処理工程において、上記カッ プリング剤は、3ーアミノプロビルトリメトキシシラ ン、3~アミノプロピルトリエトキシシラン、N~ (2 ーアミノエチル) - 3 - アミノブロビルトリメトキシシ ラン、Nー(2ーアミノエチル)-3-アミノプロピル メチルジメトキシシラン、N- (トリメトキシシリルブ ロビル) エチレンジアミン、3ーウレイドプロビルトリ エトキシシラン、イソプロピルトリ(N-アミドエチル ・アミノエチル〉チタネートの少なくとも1種のアミノ 茎を有するアミノ系カップリング剤、3ーメルカプトプ ロビルトリメトキシシラン、3-メルカプトプロビルメ チルジメトキシシランの少なくとも1種のメルカプト基 を有するメルカプト系カップリング剤のいずれか1種以 上である。

【0074】3、(b)前処理工程において、上記溶媒は、水、エタノール、メタノール、イソプロビルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、クロロホルム、塩化メチレンの少なくとも1種である。

【0075】4. (b)前処理工程において、浸漬液中の上記カップリング剤の濃度は、0.1~10wt%である。

【0076】5、(b)前処理工程において、浸漬液中の上記カップリング剤の激度は、0.5~3wt系である

【0077】6.(b)前処理工程において、金属素材の上記カップリング剤含有浸漬液中への浸漬時間は、 0.1秒~10分である。

【0078】7、(b) 前処理工程において、金属素材の上記カップリング剤含有浸漬液中への浸漬時間は、1 秒~5分である。

【0079】8.本発明の皮膜形成方法における(b) 前処理工程は、アミノ系カップリング剤及び/又はメル カプト系カップリング剤を支持電解質とを溶媒に溶かし て、金属案材を陰極にして、陰極と陽極との間に通電 し、上記カップリング剤を電解重合させ、金属表面に重 合させて間定化する方法である。

【0080】9、(b)前処理工程において、上記カップリング剤は、トリアジンチオールの一種である2、

4,6ートリメルカプトーSートリアジンチオールモノ ナトリウム塩及び/又は2,4,6ートリメルカプトー Sートリアジンチオールトリナトリウム塩である。

【0081】10. 上記「9. 」の(b) 前処理工程において、上記溶媒は、水である。

【0082】11.上記「9、」の(b)前処理工程において、上記支持電解質は、炭酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムの少なくとも1種である。

【0083】12. 上記「9.」の(b) 前処理工程に おいて、電解重合における電解質溶液の上記カップリン グ剤の濃度は、0.1 mM~100 mMである。

【0084】13、上記「9、」の(b)前処理工程において、電解重合における電解質溶液の上記カップリング剤の濃度は、5mM~50mMである。

【0085】14.上記「9.」の(b) 前処理工程に おいて、電解重合時における電流密度は、2.5~30 mA/cm²である。

【0086】15. 上記「9.」の(b) 前処理工程に おいて、電解重合時における電流密度は、10~20m A/cm² である。

【0087】16、上記「9、」の(b)前処理工程において、電解重合の通電時間は、10秒~5分である。 【0088】17、上記「9、」の(b)前処理工程において、電解重合の通電時間は、30秒~60秒である。

【0089】18. (c)皮膜形成工程(c-1,c-2)において、上記AEMの水溶液に水溶性のラジカル 重合性不飽和結合を有するモノマーを混合させる。

【0090】19. (c)皮膜形成工程(c-1,c-2)において、上記水溶性のラジカル重合性不飽和結合を有するモノマーは、アクリル酸、メタクリル酸、アクリルアミド、ヒドロキシエチルメタアクリレート、Nービニルビロリドンの少なくとも1種である。

【0091】20. (c)皮膜形成工程 (c-1, c-2)において、上記AEM水溶液中のAEM濃度は、0,01~15wt%である。

【0092】21. (c)皮膜形成工程 (c-1, c-2)において、上記AEM水溶液中のAEM濃度は、0.1~10wt%である。

【0093】22、(c)皮膜形成工程(c-1, c-2)において、金属素材浸渍時のAEM水溶液の処理pHは、2~9である。

【0094】23. (c)皮膜形成工程(c-1, c-2)において、金属素材浸漬時のAEM水溶液の処理pHは、3~6である。

【0095】24. (c)皮膜形成工程(c-1, c-2)において、金属素材浸漬時のAEM水溶液の処理温度は、0~40℃である。

【0096】25. (c)皮膜形成工程(c-1, c-2)において、金属素材浸漬時のAEM水溶液の処理温

度は、10~20℃である。

【0097】26、(c)皮膜形成工程(c-1)において、AEM水溶液に対する金属素材の浸漬時間は、0.1秒~60秒である。

【0098】27. (c)皮膜形成工程 (c-1)において、AEM水溶液に対する金属素材の浸漬時間は、1秒~15秒である。

【0099】28、(c)皮膜形成工程(c-2)において、AEM水溶液及びAEP水溶液を電解重合させる際の電圧は0.1V~300Vであり、通電時間は0.1秒~5分である。

【 0 1 0 0 】 2 9 . (c) 皮膜形成工程 (c-2) において、AEM水溶液及びAEP水溶液を電解重合させる際の電圧は5V~50Vであり、通電時間は30秒~60秒である。

【0101】30. (c)皮膜形成工程(c-1, c-2)において、(B)組成物のエマルション(AEP)及び(C)組成物の複合エマルション(AEP複合エマルション)を製造する際に、上記(A)AEMと共重合されるラジカル重合性不飽和モノマーは、スチレン、pーメチルスチレン、pークロルメチルスチレン、メタクリル酸エステル、アクリル酸エステルの少なくとも1種である。

【0102】31. (c)皮膜形成工程(c-1, c-2)において、(B)組成物のエマルション(AEP)及び(C)組成物の複合エマルション(AEP複合エマルション)のガラス転移温度(Tg)は、それぞれ-50~120℃である。

【0103】32. (c)皮膜形成工程(c-1, c-2)において、(B)組成物のエマルション(AEP)及び(C)組成物の複合エマルション(AEP複合エマルション)のガラス転移温度(Tg)は、それぞれ-25~100℃である。

【0104】33. (c)皮膜形成工程(c-1,c-2)において、浸漬水溶液中のAEP濃度又はAEP複合エマルション濃度は、1~50wt%である。

【0105】34. (c)皮膜形成工程(c-1,c-2)において、浸漬水溶液中のAEP濃度又はAEP複合エマルション濃度は、10~30wt%である。

【0106】35. (c)皮膜形成工程(c-1,c-2)において、(C)組成物の複合エマルション(AEP複合エマルション)の核である無機粒子は、シリカ、アルミナ、チタニア、フェライト、リン酸チタン、鉄粒子、亜鉛粒子の少なくとも1種である。

【0107】36. (c) 皮膜形成工程 (c-1, c-2) において、(C) 組成物の複合エマルション (AEP 複合エマルション) の核である無機粒子の粒子径は、0.01~1 μmである。

【0108】37、(c)皮膜形成工程(c-1,c-2)において、(C)組成物の複合エマルション(ABP複合エマルション)の核である無機粒子の粒子径は、0.01~0.5μmである。

【0109】38. (c)皮膜形成工程(c-1, c-2)における熱処理温度は70~150℃であり、熱処理時間は10秒~10分である。

【0110】39. (c)皮膜形成工程(c-1, c-2)における熱処理温度は90~120℃であり、熱処理時間は30秒~5分である。

【0111】40.皮膜形成方法は、必要に応じて、上記(c)皮膜形成工程の後、水洗して、熱処理工程を行う。

【0112】41. AEM水溶液を用い、(c)皮膜形成工程(c-1)は上記「5.」、「7.」、「2 1.」、「23.」、「25.」、「27.」、「3 9.」である皮膜形成方法。

【0113】42、AEP水溶液を用い、(c)皮膜形成工程(c-1)は上記「5.」、「7.」、「32.」、「34.」、「37.」、「39.」である皮膜形成方法。

【0114】43、AEM水溶液を用い、(c)皮膜形成工程(c-2)は上記「5.」、「7.」、「2 1、」、「23、」、「25.」、「29.」、「3 9.」である皮膜形成方法。

【0115】44、AEP水溶液を用い、(c)皮膜形成工程(c-2)は上記「5、」、「7、」、「2 9、」、「34、」、「37、」、「39、」である皮膜形成方法。

[0116]

【実施例】次に、実施例及び比較例を挙げて、本発明を 具体的に説明する。尚、本発明はこれらの実施例によっ て限定されるものではない。

【0117】実施例1~26及び比較例1~15

(1)(c)皮膜形成工程で用いる組成物の製造方法:製造例1、メカニカルスターラー、還流管、窒素導入管を装着した三口フラスコにスチレン41、7g、下記化15に示すアクリルアミドウンデカンノイルオキシフェニルジメチルスルホニウムメチル硫酸塩(AUPDS)3、92g、重合開始剤としてAIBAO、54g、水200gを加えた後、約30分間室温でパブリングにより窒素置換した。次いで、60℃に保った恒温槽に設置し、窒素雰囲気下、提拌速度350гpmで攪拌しながら、6時間重合を行った。反応後、凝集物を100メッシュの篩で沪過して、AEPを調製した。このAEPを「Aエマルション」とし、実施例及び比較例に供した。

[0118]

【化15】

AUPDS

製造例2、製造例1におけるAUPDSの代りに、下記化16に示すメタクリル酸フェニルジメチルスルホニウムメチル硫酸塩(MAPDS)2、68gを用いて、製造例1に準じてAEPを調製した。このAEPを「Bエ

マルション』とし、実施例及び比較例に供した。 【0119】 【化16】

MAPDS

製造例3、製造例2において、更にアクリル酸プチル1 4.4sを添加して、製造例2に準じてAEPを調製した。このAEPを「Cエマルション」とし、実施例及び 比較例に供した。

【0120】製造例4. 製造例1におけるAUPDSの 代りに、下記化17に示す4-(4-ビニルベンゾイル オキシ)フェニルジメチルスルホニウムメチル硫酸塩 (VBPDS)2.68gを用いて、製造例1に準じて AEPを調製した。このAEPを「Dエマルション」と し、実施例及び比較例に供した。

[0121] [化17]

VBPDS

製造例5.メカニカルスクーラー、還流管、窒素導入管を装着した三口フラスコに、水50g、フェライト被覆磁性粒子0.1g、下記化18に示す10ーウンデセニルオキシフェニルジメチルスルホニウムメチル硫酸塩(UPDS)0.035gを入れ、1時間超音波分散させ、6時間攪拌した後、フマル酸ジブチル0.018g及びスチレン0.017gを添加して、25でで20時間攪拌した。次いで、開始剤として過硫酸カリウム(K

PS)0.007gを加え、窒素等囲気下、撹拌速度3 50rpmで60℃で24時間重合した。反応後、凝集物を100メッシュの篩で戸過して、AEP複合エマルションを調製した。このAEP複合エマルションを「Eエマルション:とし、実施例及び比較例に供した。

[0122] [(£18]

UPDS

(2)実施例及び比較例の皮膜形成方法:

実施例1.0、3×30×70mmのSPCC鋼板(日本テストパネル(株)製)を2%脱脂剤の水溶液(日本ペイント(株)製の「サーフクリーナーT53」)に60℃で2分間浸漬し、水道水、更にイオン交換水で洗浄し、風乾後、1%イソプロピルトリ(Nーアミドエチル・アミノエチル)チタネート(味の素(株)製「プレン

アクトKR44」)のIPA溶液に2分間浸漬し、室温で乾燥し表面処理片とした。この表面処理片を5%のMAPDS水溶液に15秒間浸漬し、水道水で洗浄後、120℃の熱風オーブン中で5分間乾燥させて、(A)のAEMによる皮膜を形成した。

【0123】実施例2、実施例1におけるMAPDSの代りにAUPDSを用い、その他は実施例1に準拠して

他の(A)のAEMによる皮膜を形成した。

【0124】実施例3.実施例1におけるMAPDSの 代りにVBPDSを用い、その他は実施例1に準拠して 他の(A)のAEMによる皮膜を形成した。

【0125】実施例4、実施例1の5%MAPDS水溶 液にAIBAを1%添加し、その他は実施例1に準拠し て他の(A)のAEMによる皮膜を形成した。

【0126】実施例5、実施例1の5%MAPDS水溶液にアクリル酸を5%及びAIBAを1%添加し、その他は実施例1に準拠して他の(A)のAEMによる皮膜を形成した。

【0127】実施例6.0.3×30×70mmのSPCC鋼板(日本テストパネル(株)製)を2%脱脂剤の水溶液(日本ペイント(株)製の「サーフクリーナーT53」)に60℃で2分間浸漬し、水道水、更にイオン交換水で洗浄し、風乾後、1%イソプロビルトリ(Nーアミドエチル・アミノエチル)チタネート(味の素

(株) 製「プレンアクトKR44」)のIPA溶液に2分間浸液し、室温で乾燥し表面処理片とした。この表面処理片を製造例1の「Aエマルション」(N. V. 20%)に15秒間浸液し、水道水で洗浄後、120℃の熱風オーブン中で5分間乾燥させて、(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0128】実施例7,実施例6における「Aエマルション」の代りに「Bエマルション」を用い、その他は実施例6に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0129】実施例8.実施例6における「Aエマルション」の代りに「Cエマルション」を用い、実施例6に 準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0130】実施例9.実施例6における「Aエマルション」の代りに「Dエマルション」を用い、その他は実施例6に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0131】実施例10.実施例6における「Aエマルション」の代りに「Bエマルション」を用い、その他は実施例6に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0132】実施例11.SPCC鋼板の代わりにアルミ板を用い、その他は実施例6に準拠して(B)のAE Pによる皮膜を形成した。

【0133】実施例12、SPCC鋼板の代わりに鋼板を用い、その他は実施例6に準拠して(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0134】実施例13.実施例6において、熱乾燥前に架橋剤であるエチレンジアミン(EDA)溶液に浸漬し、その他は実施例6に準じて(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0135】実施例14.0、3×30×70mmのS PCC網板(日本テストパネル(株)製)を2%脱脂剤 の水溶液(日本ペイント(株)製の「サーフクリーナー T53;)に60℃で2分間浸漬し、水道水、更にイオン交換水で洗浄し、風乾後、1%の3-メチルカプトプロビルトリメトキシシラン(東レグウ(株)製「SH6062」)のIPA溶液に2分間浸漬し、窒温で乾燥し表面処理片とした。この表面処理片を製造例1の「Aエマルション」(N. V. 20%)に15秒間浸漬し、水道水で洗浄後、120℃の熱風オーブン中で5分間乾燥させて、カップリング剤を代えた(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0136】実施例15、実施例14における「Aエマルション」の代りに「Bエマルション」を用い、その他は実施例14に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0137】実施例16.実施例14における「Aエマルション」の代りに「Cエマルション」を用い、実施例14に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0138】実施例17.実施例14における「Aエマルション」の代りに「Dエマルション」を用い、その他は実施例14に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0139】実施例18.実施例14における「Aエマルション」の代りに「Eエマルション」を用い、その他は実施例14に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0140】実施例19.0.3×30×70mmのS PCC鋼板(日本デストパネル(株)製)を2%脱脂剤の水溶液(日本ペイント(株)製の「サーフクリーナー T53」)に60℃で2分間浸液し、水道水、更にイオン交換水で洗浄後、2,4.6-トリメルカプトーsートリアジンチオールモノナトリウム塩水溶液で定電流法により電流密度15mA/cm²、30秒間通電し、イオン交換水で洗浄し、風乾し表面表面処理片とした。この表面処理片を製造例1の「Aエマルション」(N.

V. 20%) に15秒間浸漬し、水道木で洗浄後、12 0℃の熱風オーブン中で5分間乾燥させて、カップリン グ剤を代えた(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0141】実施例20、実施例19における「Aエマルション」の代りに「Bエマルション」を用い、その他は実施例19に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0142】実施例21、実施例19における「Aエマルション」の代りに「Cエマルション」を用い、実施例19に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0143】実施例22、実施例19における「Aエマルション」の代りに「Dエマルション」を用い、その他は実施例19に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0144】実施例23.実施例19における「Aエマルション」の代りに「Eエマルション」を用い、その他は実施例19に準拠して他の(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0145】実施例24、SPCC鋼板の代わりに亜鉛板を用い、その他は実施例6に準拠して(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0146】実施例25. SPCC鋼板の代わりに溶離 亜鉛めっき鋼板板を用い、更に実施例6における「Aエマルション」の代りに「Bエマルション」を用い、その 他は実施例6に準拠して(B)のAEPによる皮膜を形 成した。

【0147】実施例26、0、3×30×70mmのSPCC鋼板(日本テストパネル(株)製)を2%脱脂剤の水溶液(日本ペイント(株)製の「サーフクリーナーT53」)に60℃で2分間浸漬し、水道水、更にイオン交換水で洗浄し、風乾後、1%イソプロビルトリ(Nーアミドエチル・アミノエチル)チタネート(味の素(株)製「プレンアクトKR44」)の1PA溶液に2分間浸漬し、室温で乾燥し表面処理片とした。この表面処理片を製造例1の「A」エマルション(N.V.20%)に電圧5V、60秒間通電し、イオン交換水で洗浄

(B)のAEPによる皮膜を形成した。

【0148】比較例1.実施例1におけるMAPDSの代りにアクリル酸(AA)を用い、その他は実施例1に準拠して皮膜を形成した。

し、120℃の熱風オーブン中で5分間乾燥させて、

【0149】比較例2、実施例1におけるMAPDSの 代りにアクリル酸(AA)を用い、更にアクリル酸水溶 液にAIBAを1%添加して、その他は実施例1に準拠 して皮膜を形成した。

【0150】比較例3.実施例1におけるイソプロビルトリ(N-アミドエチル・アミノエチル)チクネート (味の素(株)製「プレンアクトKR44」)の代わりに3ーグリシドキシプロビルエトキシシラン(チッソ (株)製S510」)を用い、その他は実施例1に準拠して皮膜を形成した。

【0151】比較例4.実施例4におけるイソプロビルトリ(Nーアミドエチル・アミノエチル)チタネート(味の素(株)製「プレンアクトドR44」)の代わりに3ークロロブロビルエトキシシラン(チッソ(株)製「S620」)を用い、その他は実施例4に準拠して皮膜を形成した。

【0152】比較例5. 実施例4におけるイソプロビルトリ(N-アミドエチル・アミノエチル)チタネート(味の素(株)製「プレンアクトKR44」)の代わりに3-グリシドキシプロビルエトキシシラン(チッソ(株)製「S510」)を用い、その他は実施例4に準拠して皮膜を形成した。

【0153】比較例6、実施例6におけるイソプロビル

トリ(N-アミドエチル・アミノエチル)チタネート (味の素(株)製「プレンアクトKR44」)の代わり に3-グリシドキシプロビルエトキシシラン(チッソ (株)製「S510」)を用い、その他は実施例6に準 拠して皮膜を形成した。

【0154】比較例7.実施例14におけるイソプロビルトリ(N-アミドエチル・アミノエチル)チタネート(味の素(株)製「プレンアクトKR44」)の代わりに3-グリシドキシプロビルエトキシシラン(チッソ(株)製「S510」)を用い、その他は実施例14に 準拠して皮膜を形成した。

【0155】比較例8. 実施例6におけるイソプロビルトリ(N-アミドエチル・アミノエチル)チタネート(味の素(株)製「プレンアクトKR44」)の代わりに3-クロロプロビルエトキシシラン(チッソ(株)製「S620」)を用い、その他は実施例6に準拠して皮膜を形成した。

【0156】比較例9.実施例14におけるイソプロビルトリ(Nーアミドエチル・アミノエチル)チタネート(味の素(株)製「プレンアクトKR44」)の代わりに3ークロロプロビルエトキシシラン(チッソ(株)製「S620」)を用い、その他は実施例14に準拠して皮膜を形成した。

【0157】比較例10.実施例6における「Aエマルション」の代りに「ニッペマイクロジェルE-5003」(日本ペイント(株)製、架橋剤樹脂粒子であって組成:n-ブチルアクリレート、粒子径60nm)を用い、その他は実施例6に準拠して皮膜を形成した。

【0158】比較例11.実施例14における「Aエマルション」の代りに「ニッペマイクロジェルE-5003」(日本ペイント(株)製、架橋剤樹脂粒子であって組成:n-ブチルアクリレート、粒子径60nm)を用い、その他は実施例14に準拠して皮膜を形成した。

【0159】比較例12.実施例6における「Aエマルション」の代りに「ニッペマイクロジェルE-100 1」(日本ペイント(株)製、架橋剤樹脂粒子であって 組成:スチレン、粒子径100nm)を用い、その他は 実施例6に準拠して皮膜を形成した。

【0160】比較例13. 実施例14における「Aエマルション」の代りに「ニッペマイクロジェルE-1001」(日本ペイント(株)製、架橋剤樹脂粒子であって組成:スチレン、粒子径100nm)を用い、その他は実施例14に準拠して皮膜を形成した。

【0161】比較例14.実施例6における「Aエマルション」の代りに「ニッペマイクロジェルE-310 1」(日本ペイント(株)製、架橋剤樹脂粒子であって 組成:スチレン、粒子径300nm)を用い、その他は 実施例6に準拠して皮膜を形成した。

【0162】比較例15、実施例14における「Aエマルジョン」の代りに「ニッペマイクロジェルE-310

1」(日本ペイント(株)製、架橋剤樹脂粒子であって 組成:スチレン、粒子径300nm)を用い、その他は 実施例14に準拠して皮膜を形成した。

【0163】(3)評価方法:

密着性試験:ゴバン目試験

塗膜にカッターで1mm平方の升目100個を描き、そのうえ型セロハンテープを圧着して瞬間的に引き剥がして、100個の升目の途膜の離脱状態を調べ、残升目数で評価した。

【0164】耐食性試験;試験片を水道水に浸漬し、

24時間後の金属表面の錆の発生状況を評価した。 【0165】

◎ : 錆発生が全面積の5%未満

〇 : 錆発生が全面積の30%未満

△ : 錆発生が全面積の50%未満

× : 錆発生が全面積の50%以上

上記実施例及び比較例の皮膜の評価結果を表1及び表2 に示す。

[0166]

【表1】

| | Ì | 金属素材 | 解髮透明 | 皮囊形成凝成物 | 至台灣於新 | 跨鐵項目 | |
|-------|-------|--------------|--------|----------------|--------|------|-----|
| | 00000 | | | | 又以系統制 | 被凝性 | 副食性 |
| 1 | 1 | 鉄 | 8844 | MAPDS | | 100 | 0 |
| - | 2 | 鉄 | KR44 | AUPUS | • | 100 | ٥ |
| * | 3 | * | 8844 | VEPDS | . 4.44 | 100 | 0 |
| - | 4 | 8 5 | KR44 | MAPDS | AIBA | 100 | ⊗ |
| - | 5 | 8 3 | XR44 | MAPDS | AlBA | 100 | O |
| 3 | | | | AA | | } | |
| × | 8 | * | KR44 | 人エマルション | ~ | 100 | 6 |
| ***** | 7 | * | XR44 | Bエマルション | - | 100 | ٩ |
| · · | 8 | * | KR44 | Cエマルション | | 100 | 0 |
| ì | 3 | * | XR44 | Dエマルション | | 100 | 0 |
| Ì | 10 | 200 | KR44 | ミエマルション | - | 100 | 0 |
| 1 | 11 | PA E | KR44 | Aエマルション | | 100 | 0 |
| ** | 2.2 | ** | KR44 | ATTAVEY | | 100 | 0 |
| - | 13 | €\$ | 8844 | ネエマルション | EDA | 190 | 0 |
| 1 | 1.4 | 兹 | 846062 | Aエマルション | ~ | 8.2 | 0 |
| 1 | 15 | \$ 3 | SH6062 | ラエマルション | ~~ | 93 | 0 |
| 3 | 1.6 | \$ | SB8062 | Cエマルション | | 8.5 | ٥ |
| 3 | 17 | 3 5. | SH6062 | Brangan | ~ | 9.8 | 0 |
| 200 | 18 | 86 | SR6062 | 名本マルション | - | 8.0 | 0 |
| 1 | 13 | 鉄 | TTN | Aエマルション | - | 8 2 | ٥ |
| | 28 | * | TTN | Bエマルション | ~~ | 9.8 | 0 |
| | 21 | ** | TTN | Cエマルション | - | 91 | 0 |
| - | 2.2 | 鉄 | TTN | ロエマルション | ^- | 8.7 | 0 |
| | 2 3 | 85. | TTN | おエマルション | | 81 | 0 |
| | 2.4 | 36.86 | KR44 | Aエマルション | | 108 | 0 |
| | 2 5 | 冷凝 更起 | XR44 | ヨエマルション | - | 196 | 0 |
| | | めっき鋼板 | | | | | |
| | 2 5 | 8% | KR44 | AZTRDED | | 100 | 133 |

| | | 金屬業材 | 散处接领 | 皮膜形成組成物 | 整合開始兩 | 計量項目 | |
|--|----|--------------|----------|----------------|-------|---------------|-----|
| | | | | | 又は架橋剤 | 密整性 | 對食性 |
| | ì | * | XR44 | A.A. | - | 遺憾せず | × |
| | 2 | 鉄 | KR44 | AA | AIBA | 強騰せず | × |
| | 3 | * | \$510 | MAPOS | | 碳酸化素 | * |
| Ħ, | s, | \$ 7: | 8518 | MAPDS | ARRA | 治難仕ず | X |
| | ธ | 8* | \$ 6 2 8 | MAPOS | AIBA | 遊戲性学 | (9) |
| €\$ | 6 | * | \$510 | AXVADED | | 经标准 | × |
| | 7 | \$ % | 8518 | AXTAVES | EDA · | 遺骸せず | × |
| | 8 | 8 \$ | 5623 | AKTADOD | - | 微粒甘甘 | × |
| | 9 | 86 | \$620 | Aエマルション | EDA | 数张 年4. | × |
| | 19 | 鉄 | XR44 | それマルション | - | 意義せず | × |
| transport of the state of the s | 11 | 88 | KR44 | FITADED | EDA | 高數存文 | Х |
| | 12 | 354 | KR44 | ジェマルション | _ | 液臓セチ | × |
| | 13 | 鉄 | KR44 | Gエマルション | EDA | 建 数化学 | х |
| | 14 | - 65 | KR44 | Hエマルション | | 爱鞭母名 | × |
| | 15 | 8 \$ | KR44 | 日エマルション | EDA | 安聚世本 | × |

注) F エマルション: 『ニッペマイクロジェルB=5003」 (日本ペイント (株) 盤、 業務消謝整粒子であって絶成:ホープチルアクリレート。 粒子径50gm)

Hエマルション:「ニッペマイクロジェルBー3101」(日本ペイント(株) 数。 業務英数数子であって起底:ステレン、数子送300nm)

これらの結果から、本発明の皮膜形成方法によれば、耐 食性、塗膜密養性のいずれの性能も優れていることが判 明した。

[0167]

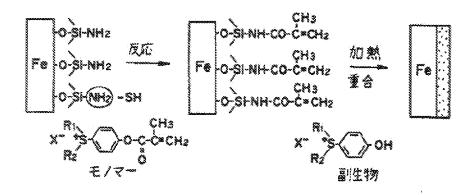
【発明の効果】以上のように、本発明に係る皮膜形成方法によれば、リンやクロム化合物等の有害物質を使用せず、金属素材との密着性及び耐食性に優れた有機皮膜又は有機/無機皮膜を金属表面に被覆することができる。 更に、スラッジを発生させることもない。また、図1~ 3に示す副生物によるインヒビター効果も期待できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の(c)皮膜形成工程における(A)組成物による皮膜形成方法を説明する図である。

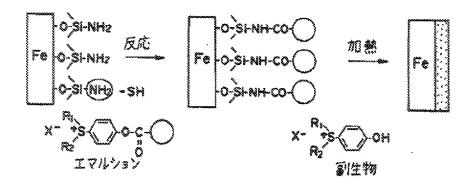
【図2】 本発明の(c)皮膜形成工程における(B) 組成物による皮膜形成方法を説明する図である。

【図3】 本発明の(c)皮膜形成工程における(C) 組成物による皮膜形成方法を説明する図である。

[XII]



[2]2]



[図3]

